

カード一覧（展示物は赤枠）

- A1 赤外線センサ・イメージャ
- A2 赤外線センサ
- A3 2軸ガルバノ電磁光スキャナ
- A4 DMD (Digital Micromirror Device) (TI (テキサス・インスツルメンツ) 米国)
- A5 DMD (Digital Micromirror Device) による映画のデジタル上映化
- A6 光エンコーダ (NTT)
- A7 圧電型・熱型インクジェットプリンタヘッド
- A8 静電インクジェットプリンタヘッド
- A9 MEMS 共振子 (米国)
- A10 MEMS 共振子 (ディスク、Lamb 波 他)
- A11 FBAR (Film Bulk Acoustic Resonator) 薄膜バルク音響波共振子
- A12 LSI 上の SAW デバイス (集積回路上の表面弾性波素子)
- A13 可変容量付帯域可変 SAW フィルタ
- A14 SAW パッシブワイヤレスセンサ

- B1 ピエゾ抵抗型圧力センサ
- B2 集積化容量型圧力センサ
- B3 振動型圧力センサ (横河電機)
- B4 容量型真空センサ
- B5 容量型真空センサ製品 (キャノンアネルバ, 大亜真空)
- B6 MEMS マイクロホン
- B7 MEMS マイクロホン ウェハ (日清紡マイクロデバイス)
- B8 耐湿性 MEMS マイクロホン
- B9 自動車用容量型加速度センサ
- B10 表面マイクロマシニングによる加速度センサウェハ (アナログデバイス 米国)
- B11 各種加速度センサ
- B12 集積化容量型加速度センサ
- B13 3軸加速度センサ
- B14 静電浮上回転ジャイロ

- C1 電磁駆動振動ジャイロ
- C2 シリコンリング式ジャイロ
- C3 圧電ジャイロ
- C4 静電駆動容量検出ジャイロ
- C5 ヨーレート・加速度センサ (トヨタ自動車)
- C6 自動車・スマホ他用 加速度センサ・ジャイロ
- C7 パターニング
- C8 エッチング (Deep RIE, XeF₂ エッチング, エッチング 中厚さモニタ)
- C9 堆積
- C10 走査プローブ顕微鏡 (SPM) プローブ
- C11 近接場光プローブとボータアンテナ
- C12 薄膜共振子による高感度センサ
- C13 マルチプローブ記録
- C14 電子源

- D1 生体電位検出用電極
- D2 半導体イオンセンサ (ISFET)
- D3 カテーテル pH, CO₂ センサ
- D4 間欠・連続血液ガスモニタ
- D5 ISFET の歯学・深海・魚飼育等への応用
- D6 マイクロ ISFET と集積化マイクロプローブ
- D7 ガスセンサ
- D8 使い捨て化学分析チップ
- D9 バイオ LSI と触覚センサネットワーク (先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム)
- D10 カテーテル血圧センサ
- D11 能動カテーテル
- D12 形状記憶合金を用いた多関節運動機構
- D13 低侵襲医療のイメージング技術
- D14 体内埋込刺激装置

- E1 LIGA プロセス
- E2 レーザプロセスとステルスダイシング
- E3 陽極接合
- E4 陽極接合できる LTCC 貫通配線基板 (ニッコー)
- E5 接合材料 (WPI-AIMR, フラウンホーファー ENAS - 東北大)
- E6 乗り合い CMOS LSI ウェハ (先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム)
- E7 レーザ消去ウェハプロセス
- E8 超並列電子ビーム描画装置 (MPEBW) (最先端研究開発支援プログラム (FIRST))
- E9 液体用マイクロポンプとマイクロバルブ・化学分析システム
- E10 マイクロミキサと粒子分析 (日立)
- E11 気体用フローセンサ・マスフローコントローラ
- E12 ベーカブルマイクロバルブ、耐蝕マスフローコントローラ
- E13 耐環境センシング

- E14 ガラスプレス成形のための炭化珪素(SiC)モールド
- F1 小形ガスタービンエンジン発電機
F2 Si マイクロタービンと熱電発電
F3 ロストモルトプロセスの SiC と PZT, 反応焼結の Si₃N₄
F4 マイクロ燃料電池
F5 マイクロ燃料改質器
F6 デジタルマイクロスラスタ (固体ロケットエンジンアレイ)
F7 静電マイクロモータ・アクチュエータ
F8 分布型静電マイクロアクチュエータ
F9 圧電マイクロステージ
F10 横方向駆動圧電マイクロアクチュエータ
F11 触覚ディスプレイと触覚イメージャ
F12 マイクロ磁気冷却機
F13 熱型 MEMS スイッチ
F14 静電・圧電型 MEMS スイッチ
- G1 波長掃引パルス量子カスケードレーザ (浜松ホトニクス(株))
G2 光学式溶融樹脂温度・圧力センサ (長野計器(株))
G3 静電容量型微差圧センサ「マノスター」(株)山本電機製作所)
G4 SEMI MEMS セミナー10周年
- H1 東北大学とベルギーIMEC (Interuniversity Micro Electronics Center)
H2 Poly-SiGe の MEMS センサ応用
H3 Poly-SiGe を用いた CMOS IC 上の MEMS ジャイロ
H4 CMOS IC 上 SiGe ミラーアレイ
H5 CMORE SiGeMEMS マルチプロジェクトウェハ
H6 ホログラフィック ディスプレイ
H7 エネルギーハーベスタ用 MEMS と電子嗅覚
- I1 圧電・静電光スキャナ
I2 ピロリ菌ウレアーゼ測定器
- J1 海底電線ケーブルの電信通信
J2 スーパーコンピュータ(大形計算機)用 CPU ボード
J3 陽極分割マグネトロンによるマイクロ波レーダ
J4 終戦前に高出力陽極分割マグネトロンを開発した島田実験所 (Z 計画)
J5 鉱石検波器と点接触トランジスタ
- J6 超並列電子ビーム描画装置
J7 新幹線車両に見るパワーデバイスの変遷
J8 磁気浮上ランプ
J9 磁気浮上リニアライナーの鉄道模型 (タカラトミー社)
J10 超電導リニア中央新幹線と鉄道模型
J11 車輪走行のリニア地下鉄(リニアメトロ)
J12 マイクロカー (株)デンソー
J13 3G スマートホン分解
J14 トノメトリ法による連続血圧波形測定装置 (オムロン HEM-9000AI)
J15 マイクロフライングロボット(μ FR) (セイコーエプソン社) (2003)
J16 展示されてる書籍に関する話題
J17 本田光多郎と魯迅に関する資料
J18 プラニメータ(面積計)と比例コンパス
- K1 西澤潤一先生に関する本や写真他
- L1 サブミクロン Au 粒子を用いた低温封止接合 (田中貴金属工業(株) 小柏俊典)
- M1 ガラス製五重の塔
- N1 赤外線アレイセンサ (パナソニック(株))
N2 3次元 LSI (株)ホンダ・リサーチ・インスティテュート・ジャパン 宮川宣明)
N3 押して発電するエネルギーハーベスタ式リモコンスイッチ (EnOcean GmpH)
N4 電気泳動表示用薄膜スイッチアレイとオンロメトリック血圧計 ((E-pape, 東京三洋電機 泉田和夫)